

(19)(12)

(KR)(A)

(51) 。 Int. Cl. 7 H05B 33/10	(11) (43)	2003-0044664 2003 06 09
(21) 10-2001-0075502		
(22) 2001 11 30		
(71)	257	
(72)	607 202	
(74)		
:		
(54)		

가
, 가
(fail)
가
.

1

1 .

< >

11 : 13 :

15 : 19 :

21 : 23 :

(electroluminescence)

, CRT

가 100 - 120 μm

EL

(handing)

가

가 10 - 50 μm

(OLED)

가 μm

가

가

가

(full color)

(electro forming)

100 μm

15 μm

가
가

가

(23) (15) (13) (13)

(13) (11) (11) 가 100 3000 μ m

(13) (19)

(15) RGB

가 가

(57)

1.

가

2.

1

3.

1

100 - 3000 μ m

4.

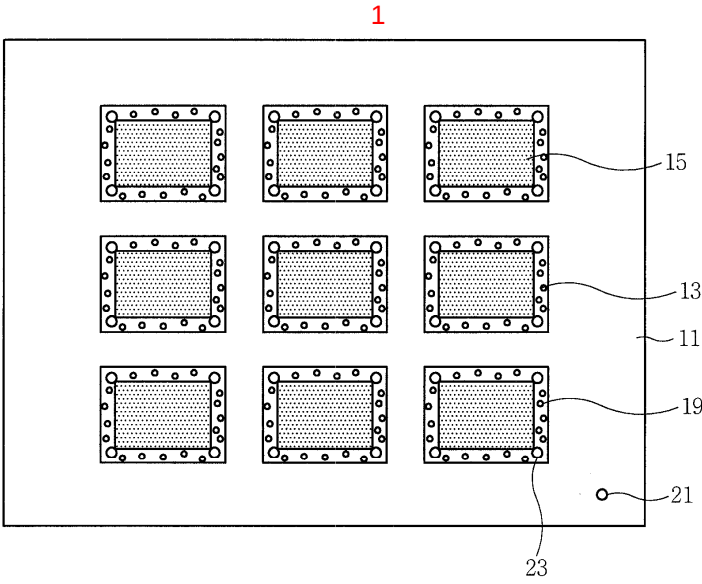
가

5.

4

6.

4



专利名称(译)	用于制造大面积有机电致发光显示装置的阴影掩模及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020030044664A	公开(公告)日	2003-06-09
申请号	KR1020010075502	申请日	2001-11-30
[标]申请(专利权)人(译)	欧丽旺电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	猎户座电器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	猎户座电器有限公司		
[标]发明人	CHUNG BOCKHYUN 정복현		
发明人	정복현		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	H01L21/0337 H01L51/0011		
代理人(译)	LEE , HOO 董		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用途：提供一种用于制造大规模有机电致发光显示装置的荫罩及其制造方法，以通过将由薄金属制成的掩模粘附到荫罩的荫罩框架来提高产量和可靠性。组成：阵列标记（21）形成在金属基板（11）的一侧。在金属基板（11）上形成光敏膜图案。通过使用光敏膜图案作为掩模蚀刻金属基板（11）来形成开口阵列区（15）。通过使用胶（23）或通过热压方法将框架（13）粘附到阵列区（15）的每个边缘单元。通过考虑通过热处理的热膨胀，在框架（13）的表面上形成多个孔（19）。阵列粘附到阵列区域（15）。

